И.Г. Половцев

О ПОГРЕШНОСТЯХ КОНТРОЛЯ ОПТИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ ПО МЕТОДУ РОНКИ

В работе анализируется чувствительность метода Ронки к ошибке волнового фронта. Представлены соотношения, показывающие, что метод Ронки с визуальным считыванием теневой карти-

ны не обеспечивает контроль оптических деталей высшей категории качества. Произведена оценка чувствительности метода нуль-теста Ронки к положению экрана и плоскости наблюдения теневой картины.

Очень часто для оценки качества оптической системы нужен оперативный, не требующий громоздкой оснастки и простой в интерпретации способ контроля. С подобной ситуацией встречается и экспериментатор, пытающийся подобрать подходящие компоненты для макетирования оптической системы, и оптик, изготавливающий оптическую деталь.

Метод Ронки [1] полностью удовлетворяет изложенным требованиям. Причем существует ряд модификаций, позволяющих применить его для контроля как сферических — метод решетки Ронки, так и асферических волновых фронтов — метод нуль-теста Ронки или криволинейного экрана. Несмотря на распространенность метода Ронки, в литературе отсутствует исчерпывающая информация о его чувствительности и устойчивости к параметрам. В настоящей работе предпринята попытка оценить возможности этой методики.

Сущность метода Ронки поясняется на рис. 1.



Рис. 1. Сущность метода Ронки: *a* — схема контроля по методу Ронки; *б* — искривление полос теневой картины

Пусть точка O — фокус волнового фронта W. На пути пучка лучей установлен экран Ронки на расстоянии S_3 от фокуса O. В плоскости, находящейся на расстоянии $S_{\rm H}$ от точки O, производится наблюдение теневой картины, представляющей проекционное изображение экрана. Если контролируемый волновой фронт — сферический, то экран Ронки представляет собой решетку прямых параллельных линий, и проекционное изображение этой решетки также будет состоять из прямых параллельных линий. Если в проекционном изображении наблюдается искривление линий тени, то это значит, что волновой фронт W имеет отступление от сферичности — волновую аберрацию N_y , которая приводит к тому, что зоны у волнового фронта имеют различные фокусы O_y , т.е. имеет место продольная сферическая аберрация $\Delta S'(y)$. Величина искривления связана с $\Delta S'(y)$, а следовательно, с N(y).

При контроле асферических волновых фронтов линии экрана Ронки (криволинейного экрана) искривлены таким образом, что в плоскости наблюдения теневой картины проекционное изображение состоит из прямых линий. Следовательно, криволинейный экран компенсирует своей кривизной искривление теневой картины, связанное с $\Delta S'(y)$, в этом смысле криволинейный экран в зарубежной литературе называют нуль-тестом Ронки. Если в проекционном изображении нуль-теста наблюдается искривление линий теневой картины, то это следует отнести к отступлениям волнового фронта от номинальной формы, т.е. асферический фронт имеет волновую аберрацию.

Из вышеизложенного нетрудно видеть, что обе модификации метода Ронки должны иметь одинаковую чувствительность к волновой аберрации N(y), при идентичных условиях наблюдения теневой картины. Но устойчивость к условиям наблюдения (т. е. к погрешности обеспечения S_3 и $S_{\rm H}$ будет различной, поскольку для решетки погрешность установки экрана и плоскости наблюдения теневой картины не имеет значения, а для криволинейного экрана это приведет к нарушению компенсации кривизны и вызовет искривление теневой картины, которое может быть отнесено за счет аберраций N(y) и скажется на результатах контроля.

Пусть луч 1 проецирует точку \mathcal{P}_1 экрана, находящуюся на высоте b в точку H_1 , находящуюся в плоскости теневой картины на высоте b'.

Если волновой фронт W имеет волновую аберрацию N, то через точку \mathcal{P}_1 пройдет уже не луч 1, а какой-то 1' — довольно близкий к 1 (при достаточно малой величине волновой аберрации) и пересекающий оптическую ось не в точке O, а в другой, отстоящей от нее на величину продольной сферической аберрации $\Delta S'$. Из рис. 1 запишем:

$$-S_{9} = b/\lg \sigma', -b' = (-S_{9} + S_{9}) \lg \sigma' - b,$$
(1)

где
 σ' — апертурный угол зоны, через которую проходит луч 1. Диф
ференцируя эти соотношения, получим:

$$\Delta S' = -dS_{\mathfrak{g}} = -\frac{bd\mathfrak{z}'}{\sin^2\mathfrak{\sigma}'}; \tag{2}$$

$$db' = \frac{\sigma_{\rm fl}}{\cos^2 \sigma'} d\sigma'. \tag{3}$$

Из (1), (2) и (3) имеем:

$$db' = \Delta S' \cdot \text{tg } \sigma' \left(\frac{S_u}{S_y} - 1 \right).$$
(4)

Соотношение (4) дает возможность определить db' — отклонение тени от прямой линии.

Предположим, что волновая аберрация N мала, следовательно, [2] можно воспользоваться соотношением:

$$\Delta S' = \frac{\partial (N)}{\partial y} \cdot \frac{R}{\operatorname{tg} \sigma'}, \qquad (5)$$

где *R* — радиус кривизны волнового фронта.

Из (4) и (5) получим

$$db' = -\frac{\partial(N)}{\partial y} \cdot R \cdot \left(\frac{S_{u}}{S_{s}} - 1\right).$$
(6)

Если

$$N(y) = \frac{A_0}{2} \left(1 + \cos 2\pi \frac{y - y_0}{T} \right),$$

где A_0 — амплитуда; y_0 — координата вершины дефекта на волновом фронте; T — его период, то

$$\left(\frac{\partial N}{\partial y}\right)_{\max} = \frac{\pi A_0}{T} \, .$$

Отсюда — максимальное отклонение тени от прямой линии

$$db'_{\max} = \left| \frac{\pi A_0}{T} \cdot R_0 \cdot \left(\frac{S_{\scriptscriptstyle H}}{S_{\scriptscriptstyle 9}} - 1 \right) \right|.$$
(7)

Проекция искривления линии db'_{T} на горизонтальную ось (см. рис. 1, δ) может быть определена из соотношения:

$$db'_T = db' \cdot \cos \chi$$
,

где χ — угол наклона к горизонтальной оси.

Поскольку максимальное искривление наблюдается у коротких линий, ближних к краю детали, то соsχ ≈ 1, отсюда

$$db' \approx db'_T$$
.

Необходимо отметить, что при использовании соотношения (7) для оценки ошибки волнового фронта (см, рис. 2) следует принять:

$$T = \begin{cases} 2D - для общей ошнбки, \\ d - для зональной ошнбки. \end{cases}$$
(8)

(Под общей ошибкой понимается низкочастотная составляющая волновой аберрации, сравнимая со световым диаметром, под зональной — высокочастотная).

$$A_0 = \begin{cases} 2N_{\max} - для \text{ общей ошнбки,} \\ N_{\max} - для \text{ зональной ошибки,} \end{cases}$$
(9)

где D — световой диаметр контролируемого волнового фронта; d — размер зоны, в которой наблюдается искривление линии; $N_{\rm max}$ — максимальное отклонение волнового фронта от номинального.

Для проверки соотношения (7) была выполнена серия модельных расчетов по программе «ЭК-РАН-У» [3].



Рис. 2. Схемы, поясняющие соотношения: a - (8), $\delta - (9)$

На сферическом зеркале с параметрами $D/R_0 = 250$ мм/1000 мм моделировалась общая ошибка изменением эксцентриситета зеркала є рассчитывались координаты линий теневой картины и вычислялась абсолютная величина проекции отклонения линии тени от прямой db'_{T} . Для вычисления $N_{\rm max}$ использовалась формула:

$$N_{\max} = 2 \cdot \varepsilon^2 \cdot \left(\frac{H^2}{2R_0}\right)^2 / 2R_0 \quad [4]$$

По формуле (7) вычислялась величина *db*' в предположении, что ошибка косинусоидальная. Результаты представлены в таблице.

> Результаты вычисления абсолютной величины искривления теневой картины при общей ошибке N_{max} по программе «ЭКРАН-У»— db'_T и по соотношению (7) для сферического зеркала db'_{max}

8	0,25	0,5	1,0	1,5
N _{max} (мкм)	4	17	68	85
$db'_{T\max}$ (MM)	0,14	0,51	2,1	4,2
db'max (MM)	0,093	0,36	1,44	4,2

Сравнение последних двух строк говорит о хорошей корреляции. Имеющиеся различия не очень существенны и ими можно пренебречь (ошибка оценки (7) не презышаетт 30%). Причины различий следующие:

—разные законы изменения профиля, в одном случае это полином второго порядка, в другом — косинусоидальный;

-db' — отклонение тени в радиальном направлении, а db'_T — проекция отклонения на ось, перпендикулярную линиям решетки.

При визуальном контроле теневой картины чувствительность методики ограничена способностью человеческого глаза различать искривление линии. По аналогии с дисторсией примем за предел чувствительности методики [5] ошибку, которая приведет к относительному искривлению:

$$\frac{db'_{\text{max}}}{b'} = 3\%.$$
⁽¹⁰⁾

Поскольку имеем

 $b' = -S_{\rm H} \cdot tg\sigma'$

то с использованием соотношения (7) можно записать:

$$\frac{d\dot{b}'_{\text{max}}}{\dot{b}} = \left| \frac{\pi A_0 \cdot R_0}{T \cdot \text{tg}\,\sigma'} \left(\frac{1}{S_9} - \frac{1}{S_H} \right) \right|. \tag{11}$$

Следовательно, согласно (8), (9) и (11) предельно различимая общая ошибка может быть определена из соотношения:

$$A_0^0 = \left| \frac{0.03}{2\pi} \left(\frac{D}{R_0} \right)^2 \cdot \frac{S_{\mathrm{H}} \cdot S_{\mathrm{g}}}{S_{\mathrm{H}} - S_{\mathrm{g}}} \right|.$$
(12)

При контроле по методу Ронки теневая картина может быть сформирована на сетчатке глаза. Хрусталик при этом устанавливается в параксиальном фокусе и аккомодируется на контролируемую деталь. Следовательно, $S_{\rm H} = -R_0$.

Для этого случая формула (12) трансформируется в соотношение:

$$A_0^{\,0} = \left| \frac{0.03}{2\pi} \cdot \left(\frac{D}{R_0} \right)^2 \cdot S_9 \right| \,. \tag{13}$$

На рис. 3, *а* приведены графики зависимости предельно различимой общей ошибки $A_0^0 = A_0(S_3)$ для разных относительных отверстий.



Рис. 3. Зависимость предельно различимой ошибки (a — общей A_0^0 , δ — зональной A_0^3) волнового фронта от относительного отверстия детали и положения экрана S_3 при контроле глазом, аккомодированным на деталь

Предельно различимая общая ошибка для случая, приведенного в таблице $D/R_0 = 250/1000;$ $S_3 = -40; S_{\rm H} = 70$, составит:

$A_0 \approx 8$ мкм,

следовательно, предельно различимый эксцентриситет є ≈ 0,35.

Оценим возможности метода Ронки для контроля зональных и местных ошибок. Согласно [6] за границу зональных ошибок можно принять T = D/10. Для этой ошибки, допущенной на краю волнового фронта, т.е. tg $\sigma' = D/2R_0$, можно записать из (10) и (11)

$$A_{0}^{3} = \left| \frac{0.03}{2\pi} \left(\frac{D}{R_{0}} \right)^{2} \cdot 10^{-1} \frac{S_{\mathrm{H}} \cdot S_{\mathrm{y}}}{S_{\mathrm{H}} - S_{\mathrm{y}}} \right|.$$
(14)

Соотношение (14) дает величину предельно различимой зональной ошибки с периодом T = D/10. При контроле глазом, аккомодированным на деталь, предельно различимая зональная ошибка составит:

$$A_{0}^{3} = \left| \frac{0.03}{2\pi} \cdot \left(\frac{D}{R_{0}} \right)^{2} \cdot 10^{-1} \cdot S_{9} \right|.$$
(15)

На рис. 3, δ приведен график зависимости предельно различимой зональной ошибки $A_0^3 = A_0(S_3)$ для разных относительных отверстий.

Таким образом, в отличие от [7], из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что метод Ронки при визуальном контроле вряд ли можно считать высококачественным в смысле критерия Рэлея, поскольку он существенно ограничен возможностями человеческого глаза.

Однако чувствительность метода Ронки можно значительно поднять, повысив точность измерения искривления полосы. Понятно, что при этом необходимо прибегнуть к фотоэлектрической обработке теневой картины. Подобное устройство должно быть снабжено бездисторсионным проекционным объективом, формирующим изображение теневой картины в плоскости фотоприемного элемента. Дисторсия объектива должна быть скорректирована (или по крайней мере измерена) с точностью, определяемой чувствительностью устройства к искривлению полос теневой картины.

Предположим, что есть устройство, позволяющее определять искривление полосы с суммарной погрешностью, не превышающей

$$\frac{db'_{\rm max}}{b'} = 0,1\%.$$

Следовательно, при радиусе изображения теневой картины b' = 8 мм, разрешающая способность фотоприемника должна быть не хуже db' = 8 мкм.

Если $S_0 = 4$ мм, $S_T = -R_0$ для детали D/R_0 , то предельно различимая общая ошибка в этом случае, согласно (13), имеет значение $A_0^0 = 0,08$ мкм, что лучше критерия Рэлея. Для выяснения устойчивости метода нуль-теста Ронки к установке плоскости наблюдения обратимся к рис. 4, *a*.

Из рис. 4, a нетрудно видеть, что при смещении плоскости наблюдения на величину $dS_{\rm H}$, искривление тени (нарушение компенсации кривизны) составит величину

$$-db_T' = \Delta S' \cdot \frac{D}{2R_0} \cdot \frac{dS_{\rm H}}{S_{\rm H}},$$

где $\Delta S'$ — продольная аберрация лучей, проходящих через среднюю линию криволинейного экрана и через его край. При сильном искривлении экрана можно считать, что $\Delta S'$ — величина продольной аберрации волнового фронта, формируемого контролируемой деталью.

Следовательно, при смещении плоскости наблюдения на величину $dS_{\rm H}$ относительное искривление линии можно определить из соотношения:

$$\frac{db'}{b'} \approx \frac{db'_T}{b'} = -\frac{\Delta S' \cdot \frac{D}{2R_0} \cdot \frac{dS_{\rm H}}{S_{\rm H}}}{D/2R_0 \cdot S_{\rm H}} = \left| \frac{\Delta S' \cdot dS_{\rm H}}{S_{\rm H}^2} \right|. \tag{16}$$

При контроле асферического зеркала 2-го порядка [7] справедлива формула

$$\Delta S' = \varepsilon^2 \frac{(D/2)^2}{2R_0} ,$$

отсюда

$$\frac{db'}{b'} = \varepsilon^2 \cdot \frac{(D/2)^2}{2R_0} \cdot \frac{dS_{\scriptscriptstyle \rm H}}{S_{\scriptscriptstyle \rm H}^2} \,.$$

Исходя из соотношения (10), получаем допустимое смещение плоскости наблюдения при контроле асферических зеркал

$$\delta S_{\mathrm{H}} = 3 \cdot 10^{-2} \cdot \frac{2R_0 \cdot S_{\mathrm{H}}^2}{(D/2)^2 \cdot \varepsilon^2}$$

В качестве примера определим $dS'_{\scriptscriptstyle \rm H}$ для параболы $D/R_0=$ = 250/1000 при $S_{\scriptscriptstyle \rm H}=-R_0,$

$$\delta S_{\rm H} \simeq 4000$$
 MM.

Более чувствительна схема контроля к малым значения
м $S_{\rm H}.$ Так, например, для той же параболы пр
и $S_{\rm H}=70~{\rm MM}$

$$\delta S_{\rm H} = 24 \, \text{MM}.$$

Из рис. 4, б видно, что компенсация кривизны линий теневой картины в плоскости ее наблюдения действительно нарушается при смещении криволинейного экрана.



Рис. 4. Чувствительность схемы контроля к смещениям плоскости наблюдения (*a*), криволинейного экрана (*б*): 1 — контролируемая деталь; 2 — криволинейный экран; 2' — смещенный криволинейный экран; 3 — плоскость компенсации кривизны экрана; 3' — плоскость наблюдения

Можно записать достаточно очевидное выражение

$$db' \approx \delta S_{\mathfrak{s}} \cdot D/2R_{\mathfrak{o}} \cdot \frac{S_{\mathfrak{H}} - \Delta S'}{-S_{\mathfrak{s}} + \Delta S'}$$
,

отсюда

$$\frac{db'}{b'} = \left| \delta S_{\mathfrak{g}} \cdot \left(1 - \frac{\Delta S'}{S_{\mathfrak{g}}} \right) \cdot \frac{1}{-S_{\mathfrak{g}} + \Delta S'} \right|.$$

При $S_{\rm H} \gg \Delta S'$, что как правило, выполняется, и из соотношения (10) допустимое смещение экрана составит

$$\delta S_{\mathfrak{s}} = 3 \cdot 10^{-2} \left(-S_{\mathfrak{s}} + \Delta S' \right).$$

Для параболы $D/R_0 = 250/1000$, при $S_{\mathfrak{s}} = -40$ мм, $\Delta S' = 15,6$ мм

$$\Delta S_{\mathfrak{H}} = 1,6$$
 MM.

При этом погрешность совмещения светового диаметра криволинейного экрана с границей светового конуса контролируемого фронта имеет вид

$$db' = \delta S_{9} \cdot \frac{D}{2R_{0}} = 0.2$$
 MM.

Этого вполне можно достигнуть, визуально контролируя совмещение.

Для устройства, позволяющего выполнять количественный контроль по методу Ронки, погрешности установки экрана и плоскости наблюдения δS_{μ} и δS_{ν} не должны превосходить следующих значений:

$$\delta S_{\mu} = db' \cdot \left(\frac{D}{2R_0}\right)^{-1},$$

$$\delta S_{\mu} = db' \cdot \frac{S_{\mu}}{S_{\mu}} \cdot \left(\frac{D}{2R_0}\right)^{-1}.$$
(18)

Соотношения (18) легко получаются из рис. 4 и показывают, с какой погрешностью должны быть установлены экран и плоскость наблюдения, если предельно различимое прибором искривление полос составляет значение $\frac{db'}{b'}$, что обеспечивает ошибку контроля, амплитуда которой не превосходит A_0 .

Так, например, при $\frac{db'}{b'}$ = 0,1% для параболы D/R_0 = 250/1000 мм; $S_{\scriptscriptstyle 9}$ = 4 мм; S_T = $-R_0$ общая

ошибка контроля $A_0 \leq 0.08$ мкм. Для этого необходимо определить положение криволинейного экрана и плоскости наблюдения теневой картины с погрешностью, не превосходящей

$$\delta S_{\rm H} = 1$$
 MM;
 $\delta S_{\rm P} = 1$ MKM.

Это уже достаточно жесткое ограничение, которое сложно выполнить.

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:

- чувствительность метода Ронки существенно зависит от схемы контроля, параметров контролируемой детали, качества фотоприемного устройства и может быть оценена по соотношениям (12), (16), (17);

— качественный контроль по методу Ронки является достаточно грубым и может использоваться только на начальных стадиях обработки оптики;

- количественный контроль по методу Ронки может осуществляться и удовлетворять критерию Рэлея только при наличии высококачественного фотоприемного устройства, позволяющего обеспечить передачу искривления полос теневого изображения, не превосходящего величины ~ 0,1%, при наличии высокой разрешающей способности устройства обработки ~ 8 мкм и средств, обеспечивающих точную установку экрана Ронки.

1. О п т и ч е с к и й производственный контроль. /Под ред. Д. Малакары. М.: Машиностроение. 1985. С. 221–249.

2. Апенко М.И., Дубовик А.С. Прикладная оптика. М.: Наука. 1971. С. 155—157. 3. Агапов Н.А., Половцев И.Г. //Аппаратура дистанционного зондирования атмосферы. Томск: ТФ CO AH CCCP. 1987. C. 128.

4. С правочник оптика-технолога. Л.: Машиностроение. 1975. С. 210-211.

5. Слюсарев Г.Г. Расчет оптических систем. Л.: Машиностроение. 1975. С. 210-215.

6. Проектирование оптических систем / Под ред. Р. Шеннона, Дж. Вайанта М.: Мир. 1983. С. 268-269. 7. Попов Г. М. //Изв. КРАО. 1972. Т. XLV. С. 1-7.

СКБ научного приборостроения «Оптика», Томск

Поступила в редакцию 14 июля 1988 г.

I.G. Polovtsev. An Error of Ronchy Method Control of Optics.

The wave-front error sensitivity of the Ronchy method is analyzed in the work. The presented correlations show that the Ronchy method with visual readout of a shadow picture does not provide for the high quality optics control. The evaluation of the null-test Ronchy method sensitivity to screen position and to shadow picture observation plane is made.

(17)